间隙及掩模偏心对采用理想模板窄带算法 共相拼接镜的影响

张永峰1,2,3 **, 鲜浩1,2 *

¹中国科学院自适应光学重点实验室,四川 成都 610209;
 ²中国科学院光电技术研究所,四川 成都 610209;
 ³中国科学院大学,北京 100049

摘要 分析间隙及偏心影响下的子孔径远场光斑形态变化,并探索采用理想圆孔径模板库匹配含间隙及偏心孔径 的远场图样进行共相的可行性及适用范围。数值仿真了不同间隙及不同掩模偏心下的远场光斑形态,得到了二者 对远场形态的影响趋势;数值模拟了采用理想模板窄带共相的过程,分析了不同间隙及不同掩模偏心下,不同平移 误差的共相精度。研究表明,间隙越大,远场扩展范围越宽;偏心越大,远场受平移误差调制的效应越不明显;当间 隙比例因子或偏心比例因子不超过 0.3 时,可直接采用理想模板共相。该研究拓展了窄带共相算法的应用,为深入 研究窄带共相算法提供了相应基础。

关键词 成像系统;拼接望远镜;平移误差测量;间隙;掩模偏心;窄带算法 中图分类号 TH751 **文献标志码** A

doi: 10.3788/LOP57.081101

Effects of Gap and Decenter of Mask on Narrow-Band Algorithm with Ideal Templates for Co-Phasing a Segmented Mirror

Zhang Yongfeng^{1,2,3 **}, Xian Hao^{1,2 *}

¹ Key Laboratory of Adaptive Optics, Chinese Academy of Sciences, Chengdu, Sichuan 610209, China;
 ² Institute of Optics and Electronics, Chinese Academy of Sciences, Chengdu, Sichuan 610209, China;
 ³ University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

Abstract In this study, we analyze the changes in the spot morphology of the far field of the subaperture under the influence of gap and decenter of mask and explore the feasibility and applicable conditions of using the ideal circular aperture template library to match the far-field pattern generated by circular templates with gap and decenter for cophasing. Further, the shape of the far-field is numerically simulated under different gaps and decenters of mask. The usage of ideal template narrow-band co-phasing is numerically simulated, and the co-phase accuracy of different piston errors under different gaps and decenters of mask is analyzed. The results prove that the far-field effect modulated by the piston error will be. The ideal co-phase template can be directly adopted when the gap scaling factor or decenter scaling factor does not exceed 0.3. In this study, we expand the application of the narrow-band co-phase algorithm and provide the basis to further study this algorithm.

Key words imaging systems; segmented telescope; piston error measurement; gap; decenter of mask; narrowband algorithm

OCIS codes 110.6770; 110.2960; 120.5050; 050.1940

收稿日期: 2019-06-05; 修回日期: 2019-07-05; 录用日期: 2019-09-06

基金项目:国家自然科学基金(11873008,61008038)、国家重点研发计划(2016YFB0501100)、中国科学院重点实验室创新基金(CXJJ-17S053)

^{*} E-mail: xianhao@ioe.ac.cn; ** E-mail: zhangyongfeng15@mails.ucas.edu.cn

1引言

随着天文学的发展,科学家团体迫切需要更大口 径的望远镜,以便能够高分辨率地观测宇宙深处晦暗 的目标。然而,受加工水平、检测技术、成本、运输、面 型控制,甚至发射空间望远镜所需整流罩体积等因素 的限制,单一大口径主镜方案显得并不现实。拼接式 反射镜方案利用多块小口径且相对易加工的子镜进 行拼接,便可达到与单一大口径镜面等同的成像效 果[1],在工程实践上为大口径望远镜建设开辟了另一 个窗口。KECK^[2]、GTC^[3]、SALT^[4]和 LAMOST^[5] 的成功运行验证了拼接式反射镜方案的可行性,正在 建设中的 E-ELT^[6]、TMT^[7]、IWST^[8]以及概念望远 镜 ATLAST^[9]等也将全部采用拼接式主镜。与此同 时,子镜共相拼接的问题随之产生。作为首个成功运 行的拼接望远镜,KECK 望远镜采用窄带模板共相法 实现子镜间的可靠精共相^[10],本文针对这一最早成 功应用的方案进行研究。

窄带模板法原理如下:当子镜间存在平移误差 时,横跨相邻子镜的微透镜可形成特别的衍射光斑, 该衍射光斑随着平移误差呈现规律性变化。将待测 平移误差状态下的衍射光斑与预先生成的模板库进 行匹配,便可获得此刻的平移误差。理论上来说,窄 带模板法要求掩模子孔径与对应子镜拼缝严格对 准。然而,在实际情况中,二者不可避免地存在失调 误差,从而导致掩模子孔径偏心。另外,造成掩模子 孔径中心遮挡的间隙有两种。一种为拼缝处一定尺 寸的物理间隙;另一种可考虑如下,拼缝对应的两个 子镜的边缘均存在抛光引起的不同程度的卷边,同 时,由于子镜长期暴露在外,其边缘将不同程度受 损,为避免子镜卷边及受损对共相精度的影响[11], 可采用含较宽中心遮挡的圆孔径作为相应的掩模子 孔径,以采样相邻子镜的卷边不显著内部区域的失 调波前,该情形也可用间隙建模。以往的研究仅给 出对应某一间隙下的远场图样[12],并没有针对间隙 及偏心对掩模子孔径远场光斑形态的影响作相关分 析。另外,在窄带算法实践应用中,需根据对应拼缝 处的间隙及偏心定标并修正模板库。但是,仅由36 块子镜拼接而成的KECK主镜,其子镜拼缝超过84 个,遑论由成百上千块子镜拼接而成的甚大望远镜。 很显然,采用定标并修正模板库的方式将严重加大 共相操作复杂性,本文提议采用不存在偏心及间隙 的理想圆孔径生成的模板库,这将节省定标及修正 模板库的消耗时间,减小共相操作复杂性。本文还 将分析使用理想圆孔径的模板库共相的可行性,得 到适用的偏心及间隙容差。

本文先给出存在间隙及偏心时,掩模子孔径远 场光斑的计算表达式;通过数值仿真,分析了仅存在 间隙或偏心时远场光斑的形态变化。另外仿真分析 了由理想圆孔径生成的模板库共相的精度,验证可 行性及适用的偏心及间隙容差。该研究拓展了窄带 共相算法的应用,为深入研究窄带共相算法提供了 相关基础。

2 理论基础

工程实践中的拼接式子镜外形多采用正六边 形,不失一般性,假设掩模子孔径为圆形。与偏心有 关的偏心矢量表达式为

 $\Delta \mathbf{r} = (\Delta x, \Delta y) = (\Delta r \cos \theta, \Delta r \sin \theta),$ (1) 式中: Δx 和 Δy 分别为沿 x方向和 y方向的偏心; Δr 和 θ 分别为偏心距离和偏心方向。实验采用的 直角坐标系如图 1 所示,图中也显示了子镜与掩模 子孔径的位置关系,深色区域为掩模子孔径理想位 置,其圆心与间隙中心重合,虚线所围圆区域对应偏 心状态的掩模子孔径位置。



图 1 直角坐标系及子镜与掩模相对位置关系

Fig. 1 Schematic of Cartesian coordinate system and relative position relationship between segment and mask

设子镜间平移误差为δ,采用单位振幅的波长 为λ的单色平面波照射,掩模所在平面的透射光场 可表示为

$$P(x,y) = \begin{cases} 0, \ (x - \Delta x)^2 + (y - \Delta y)^2 > (D/2)^2 \\ \exp(jk\delta), \ (x - \Delta x)^2 + (y - \Delta y)^2 \leqslant (D/2)^2 \text{ and } y \geqslant g/2 \\ \exp(-jk\delta), \ (x - \Delta x)^2 + (y - \Delta y)^2 \leqslant (D/2)^2 \text{ and } y \leqslant -g/2 \end{cases}$$
(2)

式中:k为空间角频率, $k=2\pi/\lambda$;D为掩模子孔径直径;g为等效间隙。根据傅里叶光学原理^[13],距孔径 f

处的焦平面上光强的分布为

$$I(u,v) = \frac{1}{(\lambda f)^2} \left| \iint P(x,y) \exp\left[-j\frac{k}{f}(ux+vy)\right] dx dy \right|^2,$$
(3)

式中:(*u*,*v*)为焦平面空间坐标。(3)式的核心积分可具体写为

$$\begin{split} I_{\text{Key}}(u,v) = & \iint P(x,y) \exp\left[-j\frac{k}{f}(ux+vy)\right] dx dy = \\ & \exp(jk\delta) \int_{g/2}^{D/2+\Delta y} \int_{\Delta r-\sqrt{(D/2)^2-(y-\Delta y)^2}}^{\Delta r+\sqrt{(D/2)^2-(y-\Delta y)^2}} \exp\left[-j\frac{k}{f}(ux+vy)\right] dx dy + \\ & \exp(-jk\delta) \int_{-D/2+\Delta y}^{-g/2} \int_{\Delta r-\sqrt{(D/2)^2-(y-\Delta y)^2}}^{\Delta r+\sqrt{(D/2)^2-(y-\Delta y)^2}} \exp\left[-j\frac{k}{f}(ux+vy)\right] dx dy = \\ & \exp(jk\delta) \frac{\exp\left[-j\frac{k}{f}(u\Delta x+v\Delta y)\right]}{j\frac{k}{f}u} \int_{g/2-\Delta y}^{D/2} \exp\left\{j\frac{k}{f}\left[u\sqrt{(D/2)^2-y^2}-vy\right]\right\} dy - \\ & \exp(jk\delta) \frac{\exp\left[-j\frac{k}{f}(u\Delta x+v\Delta y)\right]}{j\frac{k}{f}u} \int_{-D/2}^{D/2} \exp\left\{-j\frac{k}{f}\left[u\sqrt{(D/2)^2-y^2}+vy\right]\right\} dy + \\ & \exp(-jk\delta) \frac{\exp\left[-j\frac{k}{f}(u\Delta x+v\Delta y)\right]}{j\frac{k}{f}u} \int_{-D/2}^{-g/2-\Delta y} \exp\left\{j\frac{k}{f}\left[u\sqrt{(D/2)^2-y^2}-vy\right]\right\} dy - \\ & \exp(-jk\delta) \frac{\exp\left[-j\frac{k}{f}(u\Delta x+v\Delta y)\right]}{j\frac{k}{f}u} \int_{-D/2}^{-g/2-\Delta y} \exp\left\{j\frac{k}{f}\left[u\sqrt{(D/2)^2-y^2}-vy\right]\right\} dy - \\ & \exp(-jk\delta) \frac{\exp\left[-j\frac{k}{f}(u\Delta x+v\Delta y)\right]}{j\frac{k}{f}u} \int_{-D/2}^{-g/2-\Delta y} \exp\left\{-j\frac{k}{f}\left[u\sqrt{(D/2)^2-y^2}+vy\right]\right\} dy - \\ & \exp(-jk\delta) \frac{\exp\left[-j\frac{k}{f}(u\Delta x+v\Delta y)\right]}{j\frac{k}{f}u} \int_{-D/2}^{-g/2-\Delta y} \exp\left\{-j\frac{k}{f}\left[u\sqrt{(D/2)^2-y^2}+vy\right]\right\} dy - \\ & \exp\left(-jk\delta\right) \frac{\exp\left[-j\frac{k}{f}(u\Delta x+v\Delta y)\right]}{j\frac{k}{f}u} \int_{-D/2}^{-g/2-\Delta y} \exp\left\{-j\frac{k}{f}\left[u\sqrt{(D/2)^2-y^2}+vy\right]\right\} dy - \\ & \left(-j\frac{k}{f}\left(-j\frac{k}{f}(u\Delta x+v\Delta y)\right)\right] \int_{-D/2}^{-g/2-\Delta y} \exp\left\{-j\frac{k}{f}\left[u\sqrt{(D/2)^2-y^2}+vy\right]\right\} dy - \\ & \left(-j\frac{k}{f}\left(-j\frac{k$$

从(4)式可清楚地看到, Δx 仅在焦平面复振幅 中引入纯相位因子,不会引起焦平面光强分布的变 化,因此,可只考虑 $\Delta x = 0$ 时对应偏心的成像情况。 为了便于分析,定义间隙比例因子及偏心比例因子 的表达式为

$$g_{\rm ratio} = g/D$$
, (5)

$$\Delta y_{\rm ratio} = 2\Delta y / D_{\circ} \tag{6}$$

利用(5)式和(6)式表征不同的间隙及偏心程

度。 $g_{ratio} = 0$ 时代表无间隙情形; $\Delta y_{ratio} = 0$ 时代表 非偏心状态。要注意的是,(4)式中 D 的取值要大 于 $g,\Delta y$ 的绝对值要小于(D-g)/2,以保证掩模能 够覆盖采样两个子镜的相关区域,于是其约束关 系为

$$g_{ratio} - 1 < \Delta y_{ratio} < 1 - g_{ratio},$$
(7)
令 $x = Dx'/2, y = Dy'/2, u' = Du/2\lambda f, v' = Dv/2\lambda f, (4)$ 式可变形为

$$I_{\text{Key}}(u',v') = (D/2)^{2} \exp(jk\delta) \frac{\exp(-2\pi jv'\Delta y_{\text{ratio}})}{2\pi ju'} \int_{g_{\text{ratio}}-\Delta y_{\text{ratio}}}^{1} \exp\left[2\pi j(u'\sqrt{1-y'^{2}}-v'y')\right] dy' - (D/2)^{2} \exp(jk\delta) \frac{\exp(-2\pi jv'\Delta y_{\text{ratio}})}{2\pi ju'} \int_{g_{\text{ratio}}-\Delta y_{\text{ratio}}}^{1} \exp\left[-2\pi j(u'\sqrt{1-y'^{2}}+v'y')\right] dy' + (D/2)^{2} \exp(-jk\delta) \frac{\exp(-2\pi jv'\Delta y_{\text{ratio}})}{2\pi ju'} \int_{-1}^{-g_{\text{ratio}}-\Delta y_{\text{ratio}}} \exp\left[2\pi j(u'\sqrt{1-y'^{2}}-v'y')\right] dy' - (D/2)^{2} \exp(-jk\delta) \frac{\exp(-2\pi jv'\Delta y_{\text{ratio}})}{2\pi ju'} \int_{-1}^{-g_{\text{ratio}}-\Delta y_{\text{ratio}}} \exp\left[2\pi j(u'\sqrt{1-y'^{2}}-v'y')\right] dy' - (D/2)^{2} \exp(-jk\delta) \frac{\exp(-2\pi jv'\Delta y_{\text{ratio}})}{2\pi ju'} \int_{-1}^{-g_{\text{ratio}}-\Delta y_{\text{ratio}}} \exp\left[-2\pi j(u'\sqrt{1-y'^{2}}+v'y')\right] dy'$$
(8)

由于(8)式中积分的复杂性,无法对(4)式继续化简以得到其解析解。因此,在以下的仿真中,

将对(4)式中的关键积分采用数值积分法进行 计算。

3 含间隙或偏心的远场形态分析

为了分析间隙及掩模偏心对远场图样的影响, 需要结合三个因素的共同作用,分别是不同的平移 误差状态、不同的偏心状态和不同的间隙状态。实 验中,仿真不同的平移误差状态,即 $k\delta$ 取 0, $\pi/11$, $2\pi/11,3\pi/11,4\pi/11,5\pi/11,6\pi/11,7\pi/11,8\pi/11,$ $9\pi/11,10\pi/11$ 等不同值时的远场光强分布;仿真不 同的偏心状态,即 Δy_{ratio} 取0,0.1,0.3,0.5,0.7,0.9 等不同值时的远场光强分布;至于仿真不同的间隙 状态,根据文献[11],卷边效应较显著的区域尺寸有 时甚至与掩模子孔径在主镜面的投影尺寸相当,若 使掩模子孔径的采样区避开卷边区域,有必要将 g_{ratio} 取遍区间[0,1]内的值,此处 g_{ratio} 取0,0.1,0.3, 0.5,0.7,0.9等不同值。图2所示既不存在间隙,掩 模也不存在偏心时,对应不同平移误差状态下的掩 模远场衍射图样,并将此作为后续共相测量的理想 模板。



图 2 不存在间隙及掩模偏心时不同平移误差对应的远场图样。(a) 0;(b) π/11;(c) 2π/11;(d) 3π/11;(e) 4π/11; (f) 5π/11;(g) 6π/11;(h) 7π/11;(i) 8π/11;(j) 9π/11;(k) 10π/11

Fig. 2 Far field patterns without gap and mask decenter, corresponding to different piston errors. (a) 0; (b) $\pi/11$; (c) $2\pi/11$; (d) $3\pi/11$; (e) $4\pi/11$; (f) $5\pi/11$; (g) $6\pi/11$; (h) $7\pi/11$; (i) $8\pi/11$; (j) $9\pi/11$; (k) $10\pi/11$

3.1 单一因素间隙的影响分析

图 3 所示为不存在掩模偏心时,由平移误差及 间隙两个因素引起的远场变化。

从图 3 很容易发现,当间隙较小时,远场光斑的 形态变化不大,远场中存在两个较明显的光斑,且随 着平移误差的增大,呈现出一个光斑变强,另一个光 斑变弱的趋势;当间隙较大时,远场光斑形态发生很 大变化,远场中较明显的光斑将不止两个,间隙越 大,明显光斑越多,但受平移误差调制的远场变化过 程不变,上方及下方的光斑中,一方逐渐增强,另一 方逐渐减弱。远场光斑呈现左右对称性,图 4 所示 为 $k\delta$ 取 6 $\pi/11$, g_{ratio} 取不同值时,各远场沿着竖轴 的光强分布。从图 4 可以很清楚地看到,随着间隙 的增大,将大量光能分散到其余极大值上,使得所有 极大峰的强度都不高,极大峰的对比度随之降低。

3.2 单一因素掩模偏心的影响分析

无论正偏心或负偏心,只要偏心绝对值相等,那 偏心对掩模远场衍射图样产生的影响是相同的。因 此,仅分析正偏心的影响。图 5 所示为不存在间隙 时,由平移误差及掩模偏心两个因素导致的远场 变化。

从图 5 可以看到,当掩模孔径偏心严重时,由掩 模生成的远场光斑形态发生严重变化,甚至已经完 全失去非偏心状态下亮斑强度随平移误差变化的动 态趋势,这也导致采用模板法共相时,无法得到准确 的平移误差值。

通过对上述两个因素的独立分析,可以得到间 隙趋向于将能量分散到周围的极大峰上,偏心趋向 于将分散的能量集中,甚至汇聚到一个明显亮斑。 这两个因素的作用恰恰相反,因而需要确定一个恰 当的公差容限,使得光斑形态的变化不至于对使用 理想圆孔径模板的共相匹配过程产生过大的影响, 以保证子镜共相过程可精确执行。

4 理想模板窄带共相容限分析

在 KECK 望远镜共相的窄带检测算法中,需要 获取 11 组光程差间隔为 λ/11 的掩模远场衍射图 样,作为模板保存在模板库中。实际检测时,只

(a1)	(b1)	(c1)	(d1)	(e1)	(f1) •
(g1) •	(h1)	(i1)	(j1)	(k1)	g_{ratio} =0.1
(a2)	(b2)	(c2)	(d2)	(e2)	(f2)
(g2)	(h2)	(i2)	(j2)	(k2)	$g_{ m ratio}$ =0.3
(a3) • •	(b3)	(c3) • •	(d3)	(e3)	(f3)
(g3)	(h3)	(i3)	(j3)	(k3)	$g_{ m ratio}$ =0.5
(a4)	(b4)	(c4)	(d4)	(e4) • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	(f4) • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
(g4) • • • • •	(h4)	(i4)	(j4)	(k4)	g_{ratio} =0.7
					(f5)
(g5)	(h5)				$g_{ m ratio}$ =0.9

图 3 无掩模偏心,不同平移误差及不同间隙下掩模的远场图样。kδ取(a) 0;(b) π/11;(c) 2π/11;
 (d) 3π/11;(e) 4π/11;(f) 5π/11;(g) 6π/11;(h) 7π/11;(i) 8π/11;(j) 9π/11;(k) 10π/11

Fig. 3 Far field patterns from mask with different piston and gap, but without decenter. kδ equals (a) 0; (b) π/11;
(c) 2π/11; (d) 3π/11; (e) 4π/11; (f) 5π/11; (g) 6π/11; (h) 7π/11; (i) 8π/11; (j) 9π/11; (k) 10π/11

需对星曝光一次,就可获得所有相邻子镜拼缝处的 远场衍射图样。再将每个拼缝处的衍射图样与模板 库中的远场衍射图样进行互相关运算,最大相关系 数对应的模板相位就可作为被检测子镜间的相位误 差。为了提高精度,还可对相关系数曲线进行二次 拟合以便获得更准确的相位误差。由此可见,作为 窄带检测的关键参数,相关系数直接决定了平移误 差检测的准确性。采用的相关系数计算公式为^[14]

$$R = \frac{\sum_{i} (x_{i} - \bar{x}) (y_{i} - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i} (x_{i} - \bar{x})^{2} \sum_{i} (y_{i} - \bar{y})^{2}}} = \frac{\sum_{i} x_{i} y_{i} - N \bar{x} \bar{y}}{\sqrt{\left(\sum_{i} x_{i}^{2} - N \bar{x}^{2}\right) \left(\sum_{i} y_{i}^{2} - N \bar{y}^{2}\right)}}, \quad (9)$$

式中: x_i , y_i 分别为作互相关运算的两个矩阵的元素; \bar{x} , \bar{y} 分别为作互相关运算的两个矩阵的均值;N





Fig. 4 Intensity distributions for different gaps in vertical direction when $k\delta = 6\pi/11$



图 5 不存在间隙时,不同平移误差及掩模偏心下掩模的远场图样。kδ取(a) 0;(b) π/11;(c) 2π/11;
(d) 3π/11;(e) 4π/11;(f) 5π/11;(g) 6π/11;(h) 7π/11;(i) 8π/11;(j) 9π/11;(k) 10π/11
Fig. 5 Far field patterns from mask with different piston and decenter, but without gap. kδ equals (a) 0; (b) π/11;

(c) $2\pi/11$; (d) $3\pi/11$; (e) $4\pi/11$; (f) $5\pi/11$; (g) $6\pi/11$; (h) $7\pi/11$; (i) $8\pi/11$; (j) $9\pi/11$; (k) $10\pi/11$

为矩阵中元素的个数。

图 6 所示为不存在间隙及掩模偏心时,模板库 中模板间互相关系数变化情况。从图中很容易看到 模板间互相关系数的对称性,即关于 45°直线对称; 且互相关系数均在 45°直线上达到最大值,这表明 无间隙及偏心时,模板能够准确地检测出对应的平 移误差值。但是,当存在间隙或偏心时,若要使用理 想圆孔径生成的模板库成功共相,也需满足相应的 互相关系数在 45°直线上达到最大值。接下来,将 仿真使用理想圆孔径生成的模板库共相的过程,探 索理想模板窄带共相的可行性及适用范围。

4.1 关于单一因素间隙的分析

图 7 所示为存在不同大小的间隙时,掩模的远场图样与模板库中预存的模板间互相关系数的计算结果。

从图7可以得到三个结论:随着间隙增大,同一



Fig. 6 Correlation coefficients between templates

远场与无间隙及偏心的模板间的互相关系数范围急 剧压缩,该现象可从图 8 明显看到;随着间隙逐渐增 大,逐渐开始出现误匹配现象,该现象可从图 9 明显 看到;当同一远场与无间隙及偏心的模板间的互相 关系数动态范围较小时,模板法检测出现对噪声鲁 棒性弱的问题。



图 7 模板与不同间隙及平移误差下的掩模远场的互相关系数。g_{ratio}分别取(a) 0.1;(b) 0.2;(c) 0.3;(d) 0.4; (e) 0.5;(f) 0.6;(g) 0.7;(h) 0.8;(i) 0.9

Fig. 7 Correlation coefficients between templates and far field patterns of mask with different gap and piston. g_{ratio} equals (a) 0.1; (b) 0.2; (c) 0.3; (d) 0.4; (e) 0.5; (f) 0.6; (g) 0.7; (h) 0.8; (i) 0.9

根据图 9 可以获得一个针对间隙的理想模板库可用的容限系数,即为了使得采用理想模板库能够 准确共相,g_{ratio}应不大于 0.3。

4.2 关于单一因素偏心的分析

图 10 所示为存在不同大小的掩模偏心时,掩模 的远场图样与模板库中预存的模板进行互相关计算









图 9 不同间隙下的掩模远场与模板匹配情况。g_{ratio}分别取(a) 0.1;(b) 0.2;(c) 0.3; (d) 0.4;(e) 0.5;(f) 0.6;(g) 0.7;(h) 0.8;(i) 0.9

Fig. 9 Matching results between templates and far field patterns of mask with different gap. g_{ratio} equals (a) 0.1;

(b) 0.2; (c) 0.3; (d) 0.4; (e) 0.5; (f) 0.6; (g) 0.7; (h) 0.8; (i) 0.9





Fig. 10 Correlation coefficients between templates and far field patterns of mask with different decenter and piston. Δy_{ratio} equals (a) 0.1; (b) 0.2; (c) 0.3; (d) 0.4; (e) 0.5; (f) 0.6; (g) 0.7; (h) 0.8; (i) 0.9

的结果。

仅存在掩模偏心时,同一远场与无间隙及偏心 的模板间的互相关系数范围并未出现强烈的类似间 隙情形下的压缩现象,可从图 11 看到,但其误匹配 现象很严重。特别当 Δy_{ratio}的绝对值超过 0.8 时,出 现全部误匹配,如图 12 所示。

根据图 12 可以获得一个针对掩模偏心的理想 模板库可用的容限系数,即为了使得采用理想模板 库能够准确共相,Δy_{ratio}的绝对值应不大于 0.3。

5 结 论

使用拼接镜构造大口径望远镜是发展下一代 巨型望远镜的前提,但伴随出现子镜的失调误差 检测与校正的问题。模板法可实现子镜失调误差 的有效检测,但其准确性与精度会受间隙及偏心 的影响,在使用窄带共相算法时,需要定标间隙及 偏心,并修正模板库。通过数值仿真详细而全面 地分析了间隙及偏心对掩模远场的影响方式,及 采用理想模板检测平移误差的精度。结果表明, 间隙倾向于将远场能量分散,以致间隙越大,远场 能量越分散,远场的极大峰也越多,分布状态也变 得越复杂;偏心倾向于将远场能量集中,以致偏心 越大,远场能量越集中,远场中一侧极大峰变强, 另一侧极大峰变弱的趋势也被削弱;若使理想模 板库实现可靠共相,应该使得间隙因子g_{ratio}≤0.3, 偏心因子 $|\Delta y_{ratio}| \leq 0.3$ 。通过对间隙及偏心两个 因素的分析发现,即便等效子孔径存在间隙或偏 心,采用理想模板库仍可实现共相检测,从而省去 了共相前的定标及修正模板库步骤,节省时间,简 化操作。本文的分析为工程实践上采用理想模板 库共相检测的宽间隙掩模子孔径设计及掩模板与 拼接光瞳对准容差指标提供了理论依据。



(c) 0.3;(d) 0.4;(e) 0.5;(f) 0.6;(g) 0.7;(h) 0.8;(i) 0.9





(c) 0.3; (d) 0.4; (e) 0.5; (f) 0.6; (g) 0.7; (h) 0.8; (i) 0.9

Fig. 12 Matching results between templates and far field patterns of mask with different decenter. Δy_{ratio} equals (a) 0.1; (b) 0.2; (c) 0.3; (d) 0.4; (e) 0.5; (f) 0.6; (g) 0.7; (h) 0.8; (i) 0.9

参考文献

- [1] Su D Q, Cui X Q. Active optics-key technology of the new generation telescopes [J]. Progress in Astronomy, 1999, 17(1): 1-14.
 苏定强,崔向群.主动光学一新一代大望远镜的关键 技术[J]. 天文学进展, 1999, 17(1): 1-14.
- [2] Chanan G A, Nelson J E, Mast T S. Segment alignment for the keck telescope primary mirror[J]. Proceedings of SPIE, 1986, 628: 466-471.
- [3] Lefort B, Castro J. The GTC primary mirror control system [J]. Proceedings of SPIE, 2008, 7019: 70190I.
- [4] Stobie R, Meiring J G, Buckley D A H. Design of the southern African large telescope (SALT) [J]. Proceedings of SPIE, 2000, 4003: 355-362.
- [5] Cui X Q. Progress and prospect of LAMOST project[J]. Proceedings of SPIE, 2006, 6267: 626703.
- [6] Sedghi B, Müller M, Dimmler M. Analyzing the impact of vibrations on E-ELT primary segmented mirror [J]. Proceedings of SPIE, 2016, 9911: 991111.
- [7] Seo B J, Nissly C, Angeli G, et al. Investigation of primary mirror segment's residual errors for the Thirty Meter Telescope [J]. Proceedings of SPIE, 2009, 7427: 74270F.
- [8] Perrin M D, Acton D S, Lajoie C P, et al. Preparing for JWST wavefront sensing and control operations

[J]. Proceedings of SPIE, 2016, 9904: 99040F.

- [9] Bolcar M R, Balasubramanian K, Clampin M, et al. Technology development for the advanced technology large aperture space telescope (ATLAST) as a candidate large UV-optical-infrared (LUVOIR) surveyor [J]. Proceedings of SPIE, 2015, 9602: 960209.
- [10] Chanan G, Ohara C, Troy M. Phasing the mirror segments of the Keck telescopes II: the narrow-band phasing algorithm [J]. Applied Optics, 2000, 39 (25): 4706-4714.
- [11] Yaitskova N, Troy M. Rolled edges and phasing of segmented telescopes[J]. Applied Optics, 2011, 50 (4): 542-553.
- [12] Zheng B, Lu P F, Chen Y H, et al. Co-phase error detection of segmented mirrors [J]. Acta Optica Sinica, 2017, 37(11): 1112002.
 郑彬,陆培芬,陈永和,等.拼接式反射镜共相误差 检测[J]. 光学学报, 2017, 37(11): 1112002.
- [13] Lü N G. Fourier optics [M]. 2nd ed. Beijing: China Machine Press, 2006.
 吕乃光.傅里叶光学 [M].2版.北京:机械工业出版社, 2006.
- Press W H, Teukolsky S A, Vetterling W T, et al. Numerical recipes: the art of scientific computing
 [M]. 3rd ed. New York: Cambridge University Press, 2007: 745-748.